01/08 2006 15 08 FAX 01082681818 LIU SHEN & ASSOCIATES @ 002/003



especenet document view

页码,1/2

MOUNTING METHOD OF SEMICONDUCTOR DEVICE AND MOUNTING STRUCTURE THEREOF OBTAINED BY THE METHOD

Publication number: JP10303223

Publication date:

1998-11-13

Inventor:

NAGANO TAKAHIRO

Applicants

KOKUSAI ELECTRIC CO LTD

Classification:

- international:

H01L21/80: H01L21/52:

H01L23/50; H05K3/34; H05K3/30;

H05K3/32; H01L21/02:

H01L23/48; H05K3/34; H05K3/30; H05K3/32; (IPC1-7): H01L21/52; H01L21/60; H01L23/50; H05K3/34

- european:

Application number: JP19970112231 19970430 Priority number(s): JP19970112231 19970430

Report a data error here

Abstract of JP10303223 PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent peeling between a bump of a semiconductor device and a conductor of a wiring board due to warp of a wiring board by bonding a region formed between bumps in a semiconductor device and a region in a wiring board corresponding to the region in the bumps by adhesive. SOLUTION: Before a semiconductor device 10 is mounted on a printed wiring board 13, an adhesive 20 is applied to a region 16 enclosed with an electrode 17 in the printed wiring board 13 or to a region on an IC enclosed with a

file://D:\pjfb5709\jp10-303223.htm

2006-9-1

01/08 2006 15:07 FAX 01082881818

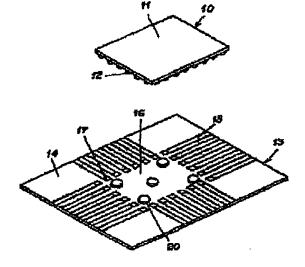
LIU SHEN & ASSOCIATES

2 003/003

esp@cenet document view

页码, 2/2

bump 12 in the semiconductor device 10. When the semiconductor device 10 is mounted on the printed wiring board 13, the semiconductor device 10 and the printed wiring board 13 are bonded by the adhesive 20 and, at the same time, the bump 12 and the electrode 17 are connected by thermally setting also a conductive connection material. Since warp of a connection part due to heat during connection is thereby restrained, the bump 12 and the conductor 15 can be surely connected electrically and mechanically.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

file://D:\pjfb5709\jp10-303223.htm

2006-9-1

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-303223

(43)公開日 平成10年(1998)11月13日

(51)Int.Cl.		識別配号	F 1			
HOIL	21/52		H01L	21/52	С	
	21/60	311		21/60	311S	
	23/50			23/50	R	
HOSK	3/34	504	HOSK	3/34	504B	

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 6 頁)

(21)出職番号

特職平9-112231

(22)出頭日

平成9年(1997)4月30日

(71)出國人 000001122

國際電気株式会社

東京都中野区東中野三丁目14番20号

(72)発明者 永野 季倍

東京都中野区東中野三丁目14番20号 西摩

包兒株式会社内

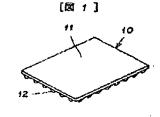
(74)代理人 弁理士 秋本 正実

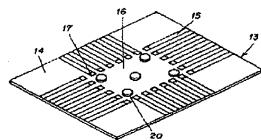
(54) 【発明の名称】 半導体装置の実装方法およびこの実装方法によって符られる半導体装置の実装構造

(57)【製約】

【課題】 配線基板が輝くても、治具を必要とせずに無 硬化性導電性接続材を硬化したきに発生する配線基板の 反りにもとづく半導体設置のバンプと配線基板の導体と を制能させずに、半導体設置と配線基板との接続をおこ なえるようにすることにある。

【解決手段】 半導体装置のバンフを配線基板の導体に 等電性接続材によって電気的に接続する以前に、半導体 装置におけるバンフの間に形成される個域と記線基板に おける郷体の間に形成される領域とを接着材によって接 含して、配線基板が薄くても、治具なしでも、バンプと 配線基板の導体との電気的接続をおこなうときの熱によって反らなくさせている。半薄体装置の実験歩留りが向 上し、低コストでもって半導体装置の実験をおこなえ る。





(2)

特開平10-303223

【特許請求の範囲】

【請求項1】 パンプをもつ半導体装置およびパンプに対応して配列された導体を形成された配線基板とを準備し、パンプと導体とを位置合わせして半導体装置を配線基板に載せ、熱処理してパンプを導体に電気的にかつ機械的に接続している半導体装置の実装方法において、半導体装置を配線基板に接続する前に、半導体装置におけるパンプの間に形成される領域と配線基板における導体の間に形成される領域とを接替材によって接合すること、を特徴とする半導体装置の実装方法。

【請求項2】 バンプをもつ半導体装置およびバンプに 対応して配列された導体を形成された配線基板とを準備 し、バンプに熱硬化性の導電性接続材を付着させ、バン プと導体とを位置合わせして半導体装置を配線基板に載 せ、導電性接続材を無硬化してバンプを導体に電気的に かつ機械的に接続している半導体装置の突装方法におい て、半導体装置を配線基板に載せる前に、半導体装置に おけるバンプの間に形成される領域に接着材を塗布し、 半導体装置を配線基板に載せたときに、配線基板を半導 体装置に接着材によって接合すること、を特徴とする半 20 導体装置の突装方法。

【請求項3】 バンプをもつ半導体装置およびバンプに対応して配列された導体を形成された配線基板とを準備し、バンプに熱硬化性の導電性接続材を付着させ、バンプと導体とを位置合わせして半導体設置を配線基板に裁せ、導電性接続材を熱硬化してバンプを導体に接続している半導体装置の突装方法において、半導体装置を配線基板に載せる前に、配線基板における導体の間に形成される領域に接着材を施布し、半導体装置を配線基板に載せたときに配線基板を半導体装置に接着材によって接合すること、を特徴とする半導体装置の突装方法。

【請求項4】 接着材を前記領域に分散して点状に塗布 してなる請求項2あるいは請求項3に記載の半導体装置 の寒暖方法

【請求項5】 バンプをもつ半導体装置とバンプに対応して配列された導体を形成した配線基板とを具備し、半導体装置のバンプが配線基板の導体に熟硬化性の導電性接続材によって接続されている半導体装置の実践構造において、半導体装置と配線基板とが半導体装置におけるバンプの間に形成される領域と配線基板における導体の間に形成される領域とを接着材によって接合されていること。を特徴とする半導体装置の実装構造。

【翻求項6】 バンアをもつ半導体装置とバンアに対応 して配列された導体を形成した配線基板とを具備し、半 導体装置のバンアが配線基板の導体に熱硬化性の導電性 接続材によって接続されている半導体装置の実式構造に おいて、半導体装置と配線基板とを半導体装置における バンプと配線基板における導体の間に形成される領域に 分散して点状に配置された接着材によって接合されてい ることを特徴とする半導体装置の実数構造。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、半導体装置の実 装方法およびこの実践方法によって得られる半導体装置 の実装構造にかかわり、さらに詳しくは、フリップチッ アの実装に好選な実装方法および実装構造に関してい る。

[0002]

【従来の技術】従来、配線基板に対するフリップチップ のようなバンプをもつ半導体装置の実装は、たとえば、 バンプの先端に熱硬化性の導電性接続材を付着させ、バ ンプと配線基板上の導体との位置を合わせて半導体装置 を配線基板に載せ、導電性接続材を熱硬化させて、バン プと配線基板の導体とを構械的にかつ電気的に接載する ことによってなされている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ うな実装方法は、配線基板が準電性投続材を熟硬化する ときの熱によって反り、硬化した薄電性接続材がそれに よって破断し、半導体装置のバンブが配線基板上の磁板 から剔離して、電気的接続が得られなくなるおそれがあ る。たとえば、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂などのフ レキシブルシートをコアとするアリント配線基板にフリ ップチップを実践するときに、熱硬化性の導電性接続材 を熱硬化させると、図3に示すように、プリント配線基 板Aが熱によって反りを生し、硬化した導電性接続材B がこの反りによって破断し、ブリップチップCのパンプ Dがプリント配線基板上の導体Eから剝離して、磁気的 接続が得られなくなる。これは配線器板の厚さが薄くな るほど増大する。電気的接続が得られなくなった製品 は、リベアにかなりのコストがかかるため、通常そのま ま不良品として破棄されている。

【0004】このような反りを防止するために、治具を使用して半導体装置を配線基板に実装する方法が知られている。治具は、たとえば図4に示すように、然によって反りにくい材質からなる板部材を、Gおよびこれらを締結するわし日とからなっている。半導体装置にの実装は、プリント配線基板Aの全側縁を板部材を、Gによって挟み、わし日よって板部材を、Gをプリント配線基板Aに搭載し、導路性接続材を発熱硬化させたあと、わし日をゆるめ、板部材を、Gをプリント配線基板Aから外すことによってななれている。しかし、このような方法では、半導体装置を実装するごとに、配線基板への治具の装着およびこれからの取り外しをおこなわなければならないため、半導体装置の実装コストがかなり増大する。

【0005】本発明の目的は、配線基板が薄くても、治 異を必要とすることなしに、薄電性接続材を無額化させ 50 たときに発生する配線基板の反りにもとづく半導体装置 (3)

特開平10-303223

のバンプと配録番板の薄体との剥離を防止することができる。改良された半導体装置の実装方法およびこの実装方法によって得られる半導体の実装構造を提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明の半導体装置の実装方法は、バンプをもつ半導体装置およびバンプに対応して配列された薄体を形成された配線基板とを準備し、バンプと導体とを位置合わせして半導体装置を配線基板に載せ、熱処理してバンプを導体に電気的にかつ機械的に接続しているが、半導体装置を配線基板に接続する前に、半導体装置におけるバンプの間に形成される領域と配接基板における導体の間に形成される領域とを接着材によって接合している。

【0007】上記目的を達成するために、本発明の半導体装置の実質構造は、バンアをもつ半導体装置とバンアに対応して配列された導体と形成した配線基板とを準備し、半導体装置のバンプを配線施板の導体に熱硬化性の導電性接続材によって接続してあるが、半導体装置と配線基板とは半導体装置におけるバンアの間に形成される 20 領域と配線基板における前記領域に対応する領域とを接着削によって接合されている。

[0008]

【発明の実施の形態】本発明によれば、半導体装置と配 線基板とを接合して、導電性接続材によってバンプと配 線基板上の導体とを接続するときの無による該接線部分 の反りをおさえているため、配線基板が薄くても、治具 を使用しなくても、バンプと導体との電気的かつ機械的 接続を確実におこなえる。

【〇〇〇9】半導体装置と配線基板との接合は、たとえ はバンフと配線基板の導体との電気的かつ機械的接続を 熱硬化性の導電性接続材によっておこなう場合、導電性 接続材をバンプに付着させると同時にあるいは付着させ る以前にもしくは付着させたあとに、配線基板における 導体の間に形成される領域に接着材を適布し、パンプと 導体とを位置合わせして半導体装置を配線基板に載せた ときに配線基板を半導体装置に接着材によって接合する ことでもって、あるいは、導電性接続材をバンプに付着 させる以前にあるいは付着させたあとに半導体装置にお けるパンプ無配置領域に接着材を塗布し、バンプと導体 とを位置合わせして半導体製置を配線器板に載せたとき に半導体装置を配線基板に接着材によって接合すること てもってなされる。このときに、配線差板あるいは半導 体装置の前記領域に分散して点状に接着料鑑布すること によって、気泡などを接着材に巻き込むことなしに、接 着村を電極にはみ出させることなしに、半導体装置と配 線基板との接合をおこなえる、

【0010】本発明の半導体装置の実装方法および実装 構造の実施例は、以下に、図1および図2を参照して説 明まれ 【0011】半導体装置10はLSI、ICなどのペアチップの電極パッド、たとえばIC11の電極パッドにバンア12を形成した半導体装置10をプリント配線基板に実装したときにIC11における電線基板13に対面する面の関縁の各々に、たとえば六個づつあり、各々の電極パッド列における電極パッドは互いに一定間隔を形成している。バンア12は、このようなIC11の電極パッドの各々に対応してIC11における配線基板13に対面する面に形成されている。

【0012】配線差板13は、エボキシ樹脂、ボリイミド樹脂、デフロン(商品名)ようなフッ化エチレン樹脂などのフレキシブルシートをコア14として、コア14の表面に導体15を形成したプリント配線基板からなっている。導体15は、バンプ12の間隔に対応する間隔を形成して平行配置された六本の導体を一組として、互いに直角に配置された四組の導体列を形成している。図示されていないが、はんだ保護膜が、導体15の内場に整極17となる部分を残して各々の導体15の上に積層されている。

【0013】半導体装置10は、バンア12をアリント配線基板13の電極17に一致させて、フェースダウンの状態にてプリント配線基板13の上に配置されているとともに、導電性接続材18によってバンア12を電極17に電気的にかつ機械的に接続されているが、さらに、IC11におけるバンプ12によって取り囲まれた領域19がアリント配線基板13における電極17あるいは導体15によって取り囲まれた領域16に接着材20によって接合されている。

【0014】アリント配線基板13に対する半導体装置 10の実装は、従来の半導体装置の実装方法と同様に、 バンプ12に熱硬化性の濃電性接続材18を付着させ、 パンプ12を懲極17に一致させて半導体装置10をプ リント配線基板13に搭載したあと、導電性接続材18 を熱硬化させ、海電性接続材18によってパンプ12と 電極17とを電気的にかつ機械的に接続することによっ てなされている。しかし、本発明による半導体装置の実 独方法では、半導体装置10をアリント配線基板13に 搭載する前に、アリント配線基板13における電極17 によって取り囲まれた領域16にあるいは半導体装置1 Oにおけるパンア12によって取り囲まれたIC上の領 或19に接着材20を塗布し、半導体装置10をプリン ト配線基板13に搭載するときに、接着材20によって 半導体装置10とプリント記録基板13とを接合し、そ れと同時に、導電性接続材18も熱硬化してパンプ12 と電極17との接続をおこなっている。 詳しく説明す

【0015】バンプ12に対する導電性接続材18の付着は、従来の半導体装置の実装方法と同様に、転写台上のエポキシ樹脂。フェノール系樹脂などの無硬化性樹脂

(4)

特別平10-303223

をパインダとする導電性接続材に半導体装置10のパン プ12を漬けることによってなされる。

【0016】半導体装置10とプリント配線基板13と の接合は、たとえばパンプ12に導電性接続材18を付 着させると同時に、アリント配線基板13の導体列の間 にあり、かつ電極17によって取り囲まれた、導体15 が配置されていない領域16に接着材20を塗布し、バ ンア12を電極17に一致させて半導体装置10をブリ ント配線基板13に搭載をおこなうときに、接着材20 によってプリント配線基板13の領域16を半導体装置 10 1.0の領域19に接合することでなされる.

【0017】また、半導体装置10とアリント配線基板 13との接合は、バンプ12に導電性接続材18を付着 させたあとに、半導体装置10におけるパンプ12の間 にあり、かつパンプ12によって取り囲まれた、パンプ 12が配置されていない「C上の領域19に接着村20 を塗布し、パンプ12を電極17に位置合わせして半導 体装置10をプリント配線基板13に搭載をおこなうと きに、接着材20によって領域19を領域16に接合す ることでなされる。

【0018】これらにおいて、プリント配線基板13あ るいは半導体設置10に対する接着材20の塗布は、図 1に示すようにプリント配線基板13における電板17 に取り囲まれた領域16の四隅と中央とに接着材20を 点状に始布することで、あるいは、半導体装置10にお ける1 C上のパンプ12にかこまれている領域19の四 関と中央とは接着材20を点状に塗布することによって なされる。

【0019】バンプ12と追極17との接続は、従来の 半導体装置の実装方法と同様に、導電性接続材18を加 30 熟して、準電性接続材18を硬化させ、導電性接続材1 8によってパンプ12を電極17に接続することによっ てなされる。

【0020】本発明による実装方法では、このように、 導電性接続材18の熱硬化をおこなうときに、半導体装 置10とブリント配線基板13とがパンプ し2あるいは 電極17によって取りかごまれた領域16,19を接着 材20によって接合され、該接合によってプリント配線 基板13におけるパンプ13に接続される電極17を含 む部位が熱硬化性導電性接続材18を硬化させるときの 熟によって反るのを抑えているため、コア14が合成樹 脂のシートからなっていても、いいかえれば、コア14 が反りにくい、高価なセラミックなどのシートでなくて も、また、治具によってプリント配線器板13の反りを 抑えていなくても、バンプ12あるいは導電性接続材1 8もしくはこれらの双方を破断させることなしに、プリ ント配線基板13に対する半導体装置10の実装をおこ なえる。さらに、半導体装置10とプリント型線基板1 3との接合が領域16,19の四隅と中央とに点状に塗 布された複巻材20によってなされていて、接着材20~50~20…接着材

の面積が小さく、気泡などが接着材20に巻き込まれな いため、プリント配線基板13への半導体装置10の実 装を確実にかつ簡単におこなうことができ、半級体装置 10とプリント配線蒸板13との接合が領域16、19 の四隅と中央とに点状に塗布した接着材20によってな され、接着材20の量が少ないため、電極17に付着さ せることなしにプリント配線越収13への接着材20の **塗布をおこなうことができ、あるいは接着材20を電極** 17にはみ出せることなしにプリント配線基板13への 半導体装置10の搭載をおこなうことができる。 いいか えれば、接着材20が電極17を覆ってバンプ12と電 概17との電気的接続をそう失させるという事故なしに プリント配線基板13への半導体装置10の実験をおこ なえる、このため、半導体装置10とプリント配線基板 13との接着という作業が加わっても、製品の歩留りが 高く、しかも、信頼性の高い実践をおこなえる。そし て、この作業のあとになされる処理において半導体装置 10に外力が加わっても、たとえば對止工程において、 封止樹脂を半導体装置10とプリント配線蒸板13との 間に供給したときに、半導体装置10にロードが加わっ ても、IC11が接着材20によってプリント配線基板 13に固定され、半導体装置10が動かないため、この ときにもバンプ12あるいは導鉱性接続材18もしくは これらの双方が破断しない。

6

[0021]

【発明の効果】本発明によれば、以上説明したように、 導電性接続材などの熱硬化にともなう配線基板の反りに よる半導体装置のバンプと配線基板の海体との剥離がな くなって、半導体装置の実装歩留りを向上させることが できるとともに、配線透板が薄くても、治臭をまったく 必要とせずにこれを実現することができるため、半導体 装置の実装を低コストでもって確実におこなうことがて

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の半導体装置の実設方法の一実施例を示 す説明図である。

【図2】本発明の半導体装度の実装方法によって得られ る半導体装置の実装構造の…例を示しており、バンゴま わりを断面にした説明図である。

【図3】従来の半導体装置の実装方法における配線基板 の状態を示す説明的である。

【図4】従来の半導体装置の他の実装方法を示す説明図 である。

【符号の説明】

10…半導体奖置

12…バンプ

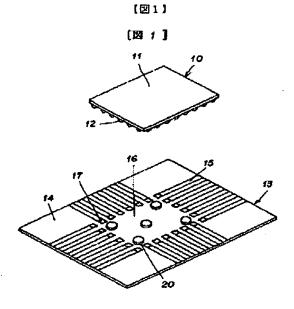
15…導体

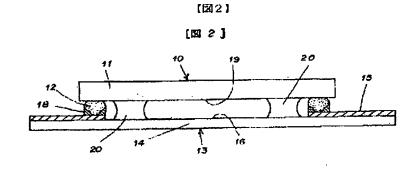
13…配線基板

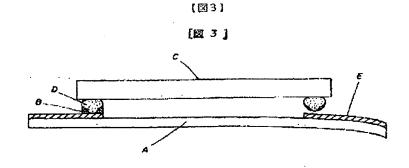
18. 導策性接続材

(5)

特開平10-303223







(6)

特闘学10-303223

[图4]

[2 4]

